62日本分類 60 Int · Cl · H 01 1 19/00 .99(5) H 0 59 G 4

19日本国特許庁

①特許出願公告

昭49-19029

特 許

49公告 昭和 49年(1974) 5月14日

発明の数 1

(全6頁)

1

匈大規模集積化回路装置の製法

印特 昭 4 3 - 7 9 3 0 2

顧 昭43(1968)11月1日 **22出**

勿発 者 藤田実 明

小平市上水本町1450株式会社

日立製作所武蔵工場内

同 牧本次生

同所

同 久保征治

国分寺市東恋ケ窪1の280株式

会社日立製作所中央研究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

. 東京都千代田区丸の内1の5の1

羽代 埋 人 弁理士 小川勝男

図面の簡単な説明

第1図は、支持基体上に構成された大規模集積 化回路装置の略式的な図、第2図は本発明の概念 ぞれ示す。

発明の詳細な説明

本発明は、1つの支持基体上に、1種又は2種 以上の電子的機能要素が多数形成され、該電子的 機能要素を相互接続して構成される大規模集贋化 25 あるいは 2本に限定されず、それら 1本は 1乃至 回路装置の製法に関する。

一般に、大規模に集積化された回路装置は、1 つの支持基体上に、1種または2種以上の電子的 機能要素が多数形成され、該電子的機能要素を相 **にトランジスタタイオード、抵抗容量等の回路素** 子によつて構成された例えばフリップフロップ、 論理ゲートあるいはそれらの複合によって、1つ の電子的機能を果す。

特性を知ることは、該回路装置の動作状態をつか むうえで重要である。

1 1

2

一般に回路装置の特性は、入力端子に信号を入 れた場合の出力端子の出力の状態で判定される、 しかしながら、多数の電子的機能要素から構成さ れる回路装置の集積化の規模が大きくなるにした 5 がつて、各電子的機能要素相互の接続が複雑にな るため、該回路装置の特性の測定が困難となる。 その原因としては、1つに各電子的機能要素が直 列、並列にあるいは多段に接続されている場合が 多いこととある電子的機能要素の出力から、また 10 ある電子的機能要素へ帰還回路が形成されてる場 合が多いことが挙げられる。

すなわち電子的機能要素が多数相互接続されて 複雑化するということは上記のような状態を意味

例えば第1図は、多数の電子的機能要素 A~G 15 が1つの支持基体上に大規模に集積化された回路 装置を表わす略式的な図であつて該電子的機能要 素は、一般にAND回路やOR回路に代表される 基本回路、あるいはフリップ回路に代表される記 的な図、第3図~第5図は本発明の実施例をそれ20憶回路さらには、それらの複合された回路から構 成されて1つの機能をもつた電子的最小単位を種 種に組み合わせて、まとまつた1つの機能をもた せたものである。したがつて、第1図に示した各 電子的機能要素相互の配線も、図示のような1本 複数本の配線群を意味するものである と し て よ いから、実際の回路は相当複雑になるのである。 以下第1図にしたがつて従来の回路装置の特性の 側定方法を述べる。従来は入力端子XとYに所望 互接続して構成される。該電子的機能要素は一般 30 の信号を入力として加え、該回路装置の出力端子 〇の出力を調べていたのであるが、図を参照して 解るように該回路装置において、電子的機能要素 AとBは互いに縦続に、電子的機能要素CとDは 並列、更に電子的機能要素Eが接続されて、破続 大規模に集積化された回路装置において、その 35 あるいは並列に電子的機能要素が接続されている とみることができる。また電子的機能要素Gの入 力側に帰還されている。

ここで、電子的機能要素Eから電子的機能要素 G に至る帰還回路が形成されていないとした場合 を考えてみる。まず入力端子X,Yに入力して、 出力端子Oの出力をみる時、電子的機能要素Aが は正常なものが得られない。同様に電子的機能要 素のが何らかの原因で故障していたとすれば、電 子的機能要素Eが正常な動作を行なつていても、 その出力は該回路装置の所望の回路機能を果し得 ないものとしてあらわれることとなる。

次に、帰還回路を考慮した場合を考えてみる。 電子的機能要素Eの出力が電子的機能要素Gの入 力に影響しているので、次段の電子的機能要素B の入力はどんなものになるのか予測がつかないか るのか測定できなくなり、該回路装置の回路機能 の良否の判定が極めてむずかしいものとなる。す なわち従来のものにおいては、例えば大型の電子 計算機を構成する際に用いられる大規模集積化回 り(入力端子が多数あり)上記入力信号が1つの 出力信号として得られる場合、それぞれの入力端 子の入力信号に対する出力信号の状態を調べるに は入力信号の種類の数の入力端子数乗もの検査回 号は、1あるいは0であるから入力信号の種類数 は 2 であつて入力端子が n あれば 2 n 回の側定を 行なわなければならず大型のコンピュウターを具 えた側定器を使用しなければならないという欠点 つていた。さらに上記電子的機能要素に、直列、 並列あるいは多段に互に異なる機能を有する電子 的機能要素が接続されていたり、帰還回路が形成 されたりすると、1 つの上記回路装置を検査する 定時間を費やすこととなる。このことは作業能率 に大きく影響し、又各電子的機能要素不良解析が めんどうになる。

また、従来の電子的回路装置において、各電子 的機能要素を検査した後、配線路を形成する場合 40 部に設けられた1対の検査端子についてみれば、 には、各電子的機能要素は正常に動作するとして も後の配線路形成において不良個所が生ずれば、 上記回路装置は全体としての機能を果さないこと となり、最終的にさらに特性検査を行なり必要が

生じ、これまた上記同様の問題を生ずると いう欠 点がある。

したがつて、本発明の目的は大規模に集積化さ れた回路装置における特性の側足回数を感じ、か 故障していた場合は、電子的機能要素 Bの入力に 5 つ上記回路装置の検査の簡単化をはかるための電 子的回路装置の製法を提供するにある。

> 本発明の他の目的は、上記大規模集積化回路接 置の各電子的機能要素および上記電子的機能要素 相互間の配線路の不良解析を容易にするための電 10 子的回路装置の製法を提供するにある。

本発明の更に他の目的は、上記大規模集積化回 路装置の製造工程上の作業能率を向上させ、量産 に好ましい電子的回路装置の製法を得るにある。

上記の直並列多段接続と帰還回路により構成さ ら、どの電子的機能要素がどのように動作してい 15 れる大規模集積化回路装置の特性の測定の難点を 除くための本発明の概略的な図を第2図に示す。 第2図によれば各電子的機能要素相互間の配線路 を遮断し、電気的に分離して各電子的機能要素の 特性を単独に検査できるので、各電子的機能要素 路装置の電子的機能要素に多数の入力信号が加わ 20 から構成される回路装置の特性の測定が容易に行 なえる。との電子的機能要素に故障があるのかを 調べるためにも、帰還回路の影響をなくすために も、各電子的機能要素相互間の配線を遮断し電気 的に分離して該電子的機能要素を検査することが 数、つまり、デイジタルのようなものでは入力信 25 望ましいわけである。第2図によれば、支持基体 の周辺部には検査端子 2~17が設けられていて、 各電子的機能要素相互間の配線の一部を遮断した 該遮断点から前記検査端子まで配線が延長してい る。これら複対数の検査端子相互を、各電子的機 があり、集積規模に大なる制限を受ける結果とな 30 能要素個々の特性を測定し総括的に回路装置の特 性を判定した後、短絡してやれば、1つの回路機 能をもつた回路装置が形成される。各電子的機能 要素と検査端子間に配線路が形成され、最終的に 全体の配線路が形成されるのは、検査後、対にな にあたつては、側定がむずかしくなりかつ長い側 35 つた各検査端子間が短絡される時であるから、検 査の際各電子的機能要素とともに配線路の検査も 行なわれる。電子的機能要素のどれかに故障発見 した時には、製造技術などの面から不良解析を行 なうことにも役立つ。ここで、前記支持基体周辺 前述のように、1つの配線路として示したものが 配線群をあらわすものであるから、1対に示した 該検査端子も検査端子群と考えなければならない。 また、支持基体周辺部に検査端子を設けたことは、

測定機器の規格化に応ずるものであり、外部出力 を取り出す時にも便利であるためである。

第2図における各電子的機能要素の検査手順は 次のとおりである。電子的機能要素Aの動作状態 を知りたければ、入力端子Xと検査端子2との間 5 部リードまで、検査端子から再びポンデイングを で、入力端子Xに適当な信号を入れてやり、その 出力を見ればよいわけで、電子的機能要素Bの場 合は、検査端子3と5に好しい信号を加えて、検 査端子6と8の出力の状態を知ればよい。同僚に、 電子的機能要素 C の場合は、検査端子 9 と 1 0 と 10 の間で、電子的機能要素 0 は検査端子 7 と 1 2 の 間で、電子的機能要素Eは検査端子11,13と 出力端子 0、検査端子 1 4 の間で、電子的機能要 素Fは検査端子15と17の間で、電子的機能要 素Gについては入力端子Y、検査端子16と検査 15 利用して該中継点45を外部出力リードとするこ 端子4の間でそれぞれ動作状態を調べることが出 来る。

以下第3図~第5図につき本発明の実施例を説 明する。第3図は、1つの支持基体40上に形成 された論理演算回路装置の電子的機能要素相互間 20 もよい。 の配線路を遮断したところであつて、一般に基本 回路と呼ばれる。a,b,c,e,f,gなる AND回路およびd,hなるOR回路や、フリッ プフロップ回路のような記憶回路等が大規模に集 積化された回路装置を構成すべき電子的機能要素 25 もよい。 である。今、第3図は、各電子的機能要素が電気 的に分離されていて、各電子的機能要素を検査で きる状態にある。例えば、AND回路&の動作状 態を知りたければ、入力端子X',Y'に適当な信号 を加えて、検査端子21の出力を調べればよいし、30 機能要素を検査できる大規模集積化回路装置の製 AND回路 bについては入力端子X,Yと検査端 子25の間で調べられる。このように、各電子的 機能要素を個々に検査してゆけるが、この時支持 基体40の周辺部に設けられた検査端子は、測定 器の探針をあてるのにしごく便利となる。また、 35 を促進する。また、入力と出力の関係も簡単に知 対になつた検査端子相互を短絡した場合、そこか ら出力を取り出す時にも有利である。

第4図 a は、第3図における各電子的機能要素 個々の検査後相互の配線路を形成すべく、支持基 体周辺部に設けられた複対数の検査端子相互を、 40 ことは製造技術の検討に役立つ。測定の簡単化は 短絡する方法を示す。短絡の手段としては、一般 に知られるポンデイングによるリード接続が用い られ、検査端子41と42が短絡される。43, 4 4は、各検査端子から電子的機能要素まで延長

している配線を示す。

第 4図 b は中継点 4 5を設けた場合を示す。検 査端子41,42を第4図aの如く相互に短絡し て、更にそこから出力を取り出したい場合に、外 してリードを引き出すとなると、相当に困難であ る。検査端子の大きさが小さく、したがつて検査 端子相互をポンディングで接続するには、**検査端** 子の中央部にポンデイングせねばならず、更に該 検査端子の残された小さな面積から、ボンデイン グリードを引き出すことは不可能であり、また、 検査端子中央のポンデイング部分に重ねてポンデ イングして外部リードに接続してもよいが、技術 的に困難である。したがつて、別の中継点45を とが好適である。

また、第 4図 cのように、例えば、ネ ールヘツ ドボンダーのポール22で、検査端子41,42 を相互短絡してもよい。46は半田金属であつて

この場合は、検査端子相互の間隔を前記実施例 の場合より小ならしめることが必要である。

この他に、ピームリード、フエイスダウンボン ディングにより検査端子相互の接続が行なわれて

第5図は、検査端子51,52に第1層アルミ ニウムを被着して、コンタクト部53を設けて第 2層アルミニウム54を被着する多層配線を示す。 本発明では、検査端子を多数設けて、各電子的 法を提供したが、このように多数の検査端子を設 けて回路装置を検査することは、見かけ上側定回 数が増すように思えるが、実際多数の情報の入力 がある場合には、検査回数を減じ、測定の簡単化 ることができ、また最終的配線路の形成が検査端 子間で行なわれるため、各電子的機能要素、各電 子的機能要素相互間の配線路中の不良個所の判定 に極めて有効である。それらの不良原因を調べる 検査を容易にし不良個所はその時に判定され、廃 棄されるから上記回路装置の歩留の向上にも結び つくこととなる。

本発明の方法は次の2つの回路装置に用いられ

8

る。1つは、1つの基板に、一種類の電子的機能 要素を多数形成しあものであつて、もり1つは一 基板上に二種以上の電子的機能要素を多数形成し たものである。前者の回路装置の場合各電子的機 子的機能要素は同種であり、製造技術上、上記電 子的機能要素に含まれる回路素子の形成条件が同 じであるから不良になる割合としては、各電子的 機能要素ともほぼ同程度とみなせる。また、同一 帰還回路が形成されない。したがつてこの回路装 置における本発明の方法の適用は不良解析の面で はあまり有効でない、それに対して後者の同路装 置は、2種以上の規模の異なる電子的機能要素の 良かという判定は、複雑な相互配線と相まつて上 記回路装置の配線路を含めた部分的検査の必要が 生じるため、本発明の適用は極めて有効である。

の特許請求の範囲

1 1つの支持基体、該支持基体により支持され た2個以上の電子的機能要素を多数相互接続して 1つの回路機能をもたせた大規模に集積化された 能要素の不良解析という点からみると、上記各電 5 回路装置の製法において、少なくとも2つの前記 電子的機能要素相互間の伝送路を遮断すべく、近 接した1对の遮断用検査端子と、前記それぞれの 電子的機能要素の入力あるいは出力端子となるべ き入出力検査端子とを支持基体周辺部に設け、か の電子的機能要素の組み合わせにおいては一般に 10 つ該検査端子より延長して前記電子的機能要素に 至る配線を施しておき、該遮断用検査端子と該入 出力検査端子とに現われる信号の関係を測定する ことによりそれぞれの電子的機能要素を独立して 検査し、しかる後電気的に分離された上記伝送路 組み合わせであるから、どの電子的機能要素が不 15 に電気的接続を形成することを特徴とする大規模 集積化回路装置の製法。

69引用文献

公 昭 38-16946 20 実



